

## ОПТИЧНІ, ОПТОЕЛЕКТРОННІ І РАДІАЦІЙНІ СЕНСОРЫ

## OPTICAL AND OPTOELECTRONIC AND RADIATION SENSORS

УДК 621.315.592

### ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ НИЗЬКОДОЗНОГО ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА СТАБІЛЬНІСТЬ КРЕМНІЄВИХ ДІОДНИХ СЕНСОРІВ ТЕМПЕРАТУРИ

*Б. В. Павлик, І. В. Гарапин, В. М. Злупко*

Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра електроніки,  
вул. Тарнавського, 107, м. Львів, 79017, тел.: (032) 2964371, факс: (032)2964730  
e-mail: pavlyk@electronics.wups.lviv.ua, garapyn@electronics.wups.lviv.ua

#### Анотація

#### ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ НИЗЬКОДОЗНОГО ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА СТАБІЛЬНІСТЬ КРЕМНІЄВИХ ДІОДНИХ СЕНСОРІВ ТЕМПЕРАТУРИ

*Б. В. Павлик, І. В. Гарапин, В. М. Злупко*

Встановлено закономірності дії іонізуючого високогенеретичного гама-опромінення ( $\text{Co}^{60}$ ) на стабільність параметрів температурних сенсорів, виготовлених на базі р-п переходів кремнієвих транзисторів із низьколегованою базою. Опромінення датчиків здійснювали при кімнатній температурі  $\gamma$ -квантами ( $\text{Co}^{60}$ , потужність дози випромінювання 0,5 Гр/с) дозами  $10\ldots10^4$  Гр. Одержані експериментальні дані свідчать, що при  $\gamma$ -опроміненні дозами  $\leq 5 \cdot 10^2$  Гр температурна характеристика сенсора стабілізується в часі і не зміщується при повторному опроміненні. Зроблено висновок, що мінімальні радіаційні зміни спостерігаються в р-п структурах з тонкою базою, що свідчить про радіаційну стійкість досліджуваних сенсорів.

**Ключові слова:** температурний сенсор, р-п переход, радіаційна стійкість

#### Abstract

#### THE PECULIARITIES OF LOW-DOSE IONIZING IRRADIATION EFFECT ON THE STABILITY OF TEMPERATURE SENSORS ON THE SILICON DIODE BASIS

*B. V. Pavlyk, I. V. Garapyn, V. M. Zlupko*

The behaviour of high-dose ionizing  $\gamma$ -irradiation ( $\text{Co}^{60}$ ) effect on the parameter stability of the temperature sensors which are produced on the basis of lightly doped base silicon p-n junction has been determined. The radiation treatment was performed under  $\gamma$ -rays ( $\text{Co}^{60}$ , dose rate 0,5 Gy/s) at room temperature at the dosage level from 10 to  $10^4$  Gy. The obtained experimental data give evidence that the temperature characteristic of sensor is stabilized upon  $\gamma$ -irradiation with doses up to  $5 \cdot 10^2$  Gy and doesn't shift at repeat irradiation. The minimal radiation-induced change is found to be in the p-n junction with a thin base thus evidencing about radiation stability of sensors under study.

**Key words:** temperature sensors, p-n junction, radiation stability

**Аннотация****ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НИЗКОДОЗНОГО ИОНИЗИРУЮЩЕГО ОБЛУЧЕНИЯ НА СТАБИЛЬНОСТЬ КРЕМНИЕВЫХ ДИОДНЫХ СЕНСОРОВ ТЕМПЕРАТУРЫ*****Б. В. Павлик, І. В. Гарапин, В. Н. Злупко***

Установлены закономерности воздействия ионизирующего высокоэнергетического гамма-излучения ( $\text{Co}^{60}$ ) на стабильность параметров температурных сенсоров, изготовленных на основе р-п переходов кремниевых транзисторов с низколегированной базой. Облучение датчиков осуществляли при комнатной температуре ( $\text{Co}^{60}$ , мощность дозы излучения 0,5 Гр/с) дозами  $10\ldots10^4$  Гр. Полученные экспериментальные данные свидетельствуют, что при  $\gamma$ -облучении дозами  $\leq 5 \cdot 10^2$  Гр температурная характеристика сенсоров стабилизируется по времени и не сдвигается при повторном облучении. Сделан вывод, что минимальные радиационные изменения наблюдаются в р-п структурах с тонкой базой, что свидетельствует о радиационной стойкости исследуемых сенсоров.

**Ключевые слова:** температурный сенсор, р-п переход, радиационная стойкость

Розробка і використання напівпровідникової сенсорів фізичних величин, здатних працювати в екстремальних умовах, є своєчасним і актуальним завданням. Особливу увагу дослідників привертають сенсори температури, параметри яких стабільні в полях дії радіації. Якщо процеси радіаційно-стимульованого дефектоутворення та деградації властивостей матеріалів при великих дозах опромінення вивчені достатньо широко [1, 2], то ефекти, які проявляються в окремих пристроях напівпровідникової електроніки при малих дозах опромінення [3, 4], вимагають дальших досліджень.

У сучасній термометрії все ширшого використання набувають кремнієві р-п- переходи з низьколегованою [5] та високолегованою [2, 6] базою. Залежно від схеми включення р-п- переходу, інформативним параметром температури може бути струм насичення ( $I_o$ ) при зворотному вмиканні або падіння напруги ( $U$ ) при прямому вмиканні. Кремнієві транзисторні сенсори температури, створені на базі прямої вітки характеристики р-п переходу (база-емітер), володіють високою чутливістю і точністю вимірювання, стабільністю характеристик в діапазоні температур від -20 до +150°C. Дія зовнішніх факторів на такі термосенсори вивчена далеко не повністю.

Метою даної роботи було встановлення закономірності дії іонізуючого високо енергетичного гамма випромінювання ( $\text{Co}^{60}$ ) на стабільність параметрів температурних сенсорів, виготовлених на базі р-п переходів кремнієвих

транзисторів із низьколегованою базою. Отримані результати дозволяють покращити експлуатаційні параметри термометрів та сприятимуть розширенню області їх використання.

**Об'єкти дослідження та критерії їх вибору**

Нами досліджувались датчики портативних термометрів ТП-2Н [6], розроблені на основі безкорпусних транзисторів КТ-354-2. Дані термометри призначенні для вимірювання температури в різних середовищах від -20 до +150°C (межа допустимого значення основної похибки від  $\pm 0,1$  до  $\pm 0,5^\circ$ ). За стабільністю характеристик дані термометри не поступаються традиційним платиновим термоперетворювачам опору, але є на порядок дешевими.

При розробці критеріїв придатності для використання кремнієвих термосенсорів на базі р-п переходів в умовах дії іонізуючого випромінювання ми виходили з аналізу відомого рівняння Шоклі:

$$I_{np} = I_S \left( e^{\frac{U_{np}}{\varphi_T}} - 1 \right) + I_R \left( e^{\frac{U_{np}}{2\varphi_T}} - 1 \right), \quad (1)$$

де  $I_{np}$  — повний струм через р-п переход;

$I_S$  — струм насичення;

$I_R$  — рекомбінаційний струм;

$\varphi_T$  — тепловий потенціал ( $kT/q$ ),

$k$  — стала Больцмана;

$T$  — абсолютна температура в К;

$q$  — заряд електрона.

За умови, що  $|U_{np}| \gg I_{np} \cdot r_0$ ;  $U_{np} \ll \varphi_T$ ;  $T = T_0$  отримаємо значення:

$$I_{so} = \frac{|q| D S P_{no}}{L \cdot th\left(\frac{W}{L}\right)}; I_{ro} = \frac{|q| \varphi_T P_{no} D W}{(\Delta \varphi_0 - U_{np}) L^2}, \quad (2)$$

де  $P_{no}$  – рівноважна концентрація неосновних носіїв заряду;

$\Delta \varphi_0$  – потенціальний бар'єр р-п переходу;

$L$  – дифузійна довжина пробігу носіїв заряду;

$W$  – геометрична ширина бази;

$S$  – площа р-п переходу;

$D$  – коефіцієнт дифузії.

З аналізу виразів (1), (2) випливає, що основною радіаційно-чутливою величиною є дифузійна довжина пробігу носіїв заряду, яка в свою чергу визначається вихідними властивостями даного матеріалу і змінюється під дією зовнішнього впливу (зокрема, опромінення):

$$L = \sqrt{D \tau_{ef}}; \text{ де } \tau_{ef} = \frac{\tau_v \cdot \tau_s}{\tau_v + \tau_s}, \quad \tau_v \text{ — постійна}$$

часу об'ємної рекомбінації;  $\tau_s$  – постійна часу поверхневої рекомбінації. Постійна часу  $\tau_v$  залежить від структурної досконалості кристалічної гратки (концентрації та типу дефектів, в т.ч. і радіаційних).

Відомо також, що час життя неосновних носіїв заряду залежить від величини поглинутої дози:  $\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_0} + k\Phi$ , де  $k$  – коефіцієнт, який визначається швидкістю введення рекомбінаційних центрів, їх перерізом захоплення та рівнем заповнення (для n-Si –  $k = (4.0 \pm 1.0) \cdot 10^{-7} \left( \frac{cN_v}{cm^2} \right)^{-1}$ ),  $\Phi$  – величина поглинутої дози.

Хоча опромінення генерує у забороненій зоні низку енергетичних рівнів, проте час життя визначається тільки одним-двома домінуючими рівнями. Виходячи з цих міркувань, для зменшення залежності  $\tau_v$  від дії зовнішніх факторів та усунення їх впливу на стабільність характеристик необхідно, щоб для р-п переходів виконувалась умова:  $L >> W$  (тобто повинна бути тонка база). Наявність низького ступеня легування бази і її мала товщина зводять до мінімуму вплив релаксаційних процесів на величини  $I_{so}$  та  $I_{ro}$ . Даним вимогам задовільняє емітерний перехід надвисокочастотного транзистора з високим значенням коефіцієнта передачі струму бази, в якого колектор закорочений на базу.

### Отримані результати та їхній аналіз

Об'єктом дослідження були термосенсори на основі високочастотного кремнієвого р-п переходу з низьколегованою базою. Робочий струм сенсора –  $1 \cdot 10^{-4}$  А, коефіцієнт стабілізації струму –  $2 \cdot 10^{-4}$ . Температура відтворювалась в реперній точці  $0^\circ\text{C}$ . Опромінення датчиків здійснювали при кімнатній температурі  $\gamma$ -квантами ( $\text{Co}^{60}$ , потужність дози випромінювання  $0,5 \text{ Гр/с}$ ) дозами ( $10 \dots 10^4 \text{ Гр}$ ). Вимірювання зсуву температурної характеристики в реперній точці проводили як після опромінення (І вимір), так і згодом, через 8 та 35 днів після витримки при кімнатній температурі (відповідно, ІІ та ІІІ вимір). Сенсори №1-3 були повторно опромінені дозою 7 Гр. Результати вимірювань наведені в таблиці.

Одержані експериментальні дані свідчать, що при гамма-опроміненні дозами  $\leq 5 \cdot 10^2 \text{ Гр}$  температурна характеристика стабілізується в часі і не зміщується при повторному опроміненні. Причому величина спаду напруги на р-п переході при температурі  $0^\circ\text{C}$  і значенні струму  $1 \cdot 10^{-4}$  А зменшувалась порівняно з вихідним значенням (до опромінення). Враховуючи, що р-п перехід включений в прямому напрямку, а наявність низького ступеня легування бази і її мала товщина зводять до мінімуму вплив релаксаційних процесів на величини  $I_{so}$  та  $I_{ro}$  (2), можна зробити висновок, що вимірюваний спад напруги під дією температури зумовлений властивостями області просторового заряду (ОПЗ). Тому проаналізуємо дію опромінення на  $U_{p-n}$ . Отже,  $U_{p-n} = f(J_{np}, \tau_{p-n})$ . Враховуючи, що у повному струмі через р-п перехід домінує складова, зумовлена рекомбінацією носіїв заряду в ОПЗ, можемо записати:

$$U_{p-n} = \frac{mkT}{q} \ln \left( \frac{J_{np} \tau_{p-n}}{qn_i W} \right).$$

Оскільки  $\tau = f(\Phi)$ , то і  $U_{p-n} = f(\Phi)$ .

Зростання  $\tau$  під дією опромінення на початковій стадії і його подальший вихід на насичення (стабілізація характеристик сенсора) ми інтерпретуємо наступним чином:

1. ОПЗ порівняно з об'ємом кристалу є завжди більш дефектною структурою.

2. Безпосередньо в процесі опромінення реальних кристалічних структур зростає коефіцієнт дифузії як носіїв заряду, так і дефектів кристалічної гратки. При формуванні р-п структур на межі їх поділу утворюються метастабільні стани дефектів.

Таблиця

№ сенсора	Доза опромінення (Гр.)	Величина абсолютної похибки вимірювання температури, $\Delta T(^{\circ}\text{C})$			Доза повторного опромінення, (Гр.)	Величина абсолютної похибки вимірювання температури, $\Delta T(^{\circ}\text{C})$	
		I вимір	II вимір (через 200 год. після I виміру)	III вимір (через 850 год. після II виміру)		IV вимір	V вимір (через 850 год. після IV виміру)
1	$1,5 \cdot 10^1$	-0,1	-0,1	0,0	7,0	+0,0	0,0
2	$5,0 \cdot 10^1$	+0,2	+0,2	+0,1	7,0	+0,1	+0,1
3	$5,0 \cdot 10^2$	+0,1	+0,1	+0,1	7,0	+0,1	+0,1
4	$1,0 \cdot 10^3$	+0,5	+0,2	+0,2	-	+0,1	+0,1
5	$5,0 \cdot 10^3$	+0,3	+0,2	+0,1	-	+0,1	+0,1
6	$1,0 \cdot 10^4$	+0,2	+0,2	+0,2	-	+0,1	+0,2

3. При великих рівнях інжекції ( $\Delta p_n >> n_n$ ) повний струм через p-n перехід визначатиметься не рекомбінаційною, а дифузійною складовою і радіаційно-стимульована швидкість зміни

$$\frac{dU_{pn}}{d\Phi} / J_{np=const} = \frac{J_{np} W}{\sigma_0^2} \frac{d\sigma_0}{d\Phi}$$

буде великою на початковій стадії опромінення ( $\Phi < 1 \cdot 10^3$  Гр). При збільшенні дози процеси генерації радіаційних дефектів домінують над рекомбінаційними процесами і ефективність перших є вищою.

4. При опроміненні характер зміни  $U_{p-n}$  та  $U_b$  в діодних структурах є протилежним (при  $\Phi < \Phi_{kp}$ ), що пояснюється різними швидкостями радіаційних змін к та  $\frac{d\sigma}{d\Phi}$ .

## Висновки

1. Мінімальні радіаційні зміни спостерігаються в p-n структурах з тонкою базою, що свідчить про радіаційну стійкість досліджуваних сенсорів. Підтвердженням цього є досить велике ( $10^3$  Гр) значення  $\Phi_{kp}$  і малі значення зміни абсолютної похибки вимірювання температури.

2. У процесі опромінення ( $\Phi < \Phi_{kp}$ ) в сенсорі температури відбувається одночасно декілька процесів, частина з яких є конкуруючими. Тому ми вважаємо, що на початковій стадії опромінення домінують процеси, пов'язані з переходом дефектів структури із метастабільного у стабільний стан, що аналогічне до факту покращення структурної досконалості, а значить і стабілізації температурних характеристик сенсора.

3. З врахуванням ефекту впорядкування дефектної структури, вираз для дозової залежнос-

ті зміни часу життя носіїв заряду на початковій стадії опромінення ( $\Phi < \Phi_{kp}$ ) можна записати так:

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_0} + \kappa \Phi - A(\Phi, x_0),$$

де  $A(\Phi, x_0)$  — функція, яка враховує структурну досконалість зразка ( $x_0$ ), вид опромінення та його характеристики ( $\Phi$ ).

Ця робота виконана при фінансовій підтримці Міністерства освіти і науки України (№ДР 0105У002236).

## Література

1. Винецкий В.Л., Холодарь Г.А., Радиационная физика полупроводников. — К.: Наукова думка, 1979. — 336 с.
2. Хіврич В.І., Ефекти компенсації у напівпровідниках та сенсори радіації на цій основі: Автореф. дис. докт. фіз. — мат. наук, 01.04.10. — Одеса., 2006. — 40 с.
3. Pavlyk B.V., Lyshak M.V., On the model of radiation-induced ordering of the defect structure in CdS crystals // Ukr. J. of Phys. — 2006. — Vol.51, №3. — P. 275-279.
4. Борковская О.Ю., Дмитрук Н.Л., Литовченко В.Г., Мищук О.Н., К моделі ефекта радиационно-стимулированного упорядочения в полупроводниках А<sup>III</sup>В<sup>IV</sup> // Физ. и техн. полупр. — 1989. — Т.23, Вып.2. — С. 2007-2012.
5. Патент №23648А. МКИ G 01 K 7/02. Леновенко А.М., Василюк В.М., Капітан В.І., Електронний цифровий термометр. — Заявл. 29.11.96; Опубл. 02.06.1998. — 3 с.
6. Shwarts Yu.M., Borblik V.L., Kulish N.R. et al., Radiation-resistant silicon diode temperature sensors // Sensors and Actuators A., Physical. — 2002. — Vol.97-98. — P. 271-279.